

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ANALYSE D'UN ASSEMBLAGE À REMPLISSAGE ALÉATOIRE DES POINTS DE TEST PAR LES PARAMÈTRES MESURÉS

Avantages technologiques

Couplage simple :

- Couplage de deux équipements qui ne sont pas faits pour fonctionner ensemble

Analyse multi paramètres :

- Gain de temps important pour des analyses complexes

Système performant :

- Résultats d'analyse fiables et exploitables sans nécessité un remplissage des mesures pour l'intégralité des points

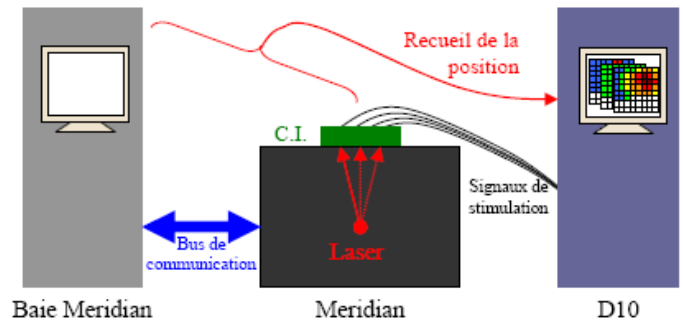


Schéma synoptique fonctionnel d'un dispositif d'analyse

Synthèse de l'invention

L'invention concerne un procédé et un dispositif d'analyse d'un assemblage électronique de localisation des défaillances.

Pour localiser un défaut à l'intérieur d'un circuit intégré, un faisceau laser vient balayer et activer des zones sensibles à l'échelle du micromètre (brevet CNES).

La localisation des défauts nécessite souvent que le circuit intégré fonctionne pendant le balayage laser.

L'invention propose le couplage du microscope laser avec un testeur de composant à travers une carte électronique de détection spécifique.

Bénéfices commerciaux

- Système performant d'analyse multi paramètres offrant en gain en temps d'analyse

Applications potentielles

- Analyse de défaillance nécessitant des microscopes laser et un testeur de composant dans le domaine des semi-conducteurs

Invention brevetée disponible sous licence.